

## 第32回表面科学基礎講座

### 表面・界面分析の基礎と応用

協 賛 日本化学会、日本物理学会、応用物理学会、日本トライボロジー学会、日本金属学会  
 (交渉中) 電子情報通信学会、日本電子顕微鏡学会、電気化学会、表面技術協会、粉体工学会  
 日本材料学会、電気学会、日本材料科学会、日本機械学会、日本セラミックス協会  
 日本真空協会、高分子学会、日本油化学会、日本分析化学会、軽金属学会、化学工学会  
 日本質量分析学会、触媒学会、粉体粉末冶金協会、日本分光学会

近年、表面・界面分析技術はめざましく進歩し、学術的研究はもとより、産業界における研究開発や品質評価などに盛んに利用されています。日本表面科学会では、初心者、若手研究者、技術者を対象として、表面・界面分析の基礎と応用を入門的に、かつ具体例を豊富に解析する事を目的として表面科学基礎講座を開設し、大好評を博しております。

今年度も、第2回目(秋季)の講座を下記のプログラムにて関西地区で開催することに致しました。特に参加者との質疑応答の機会を多く設けることにより、新規受講者だけでなく、日々各種の問題点を多数抱えておられる既受講者にも充分満足いただけるように致しましたので、既受講者も含めた多数の方々の参加をお勧め致します。

#### □ プログラム (第32回 表面科学基礎講座 2001年11月7日~8日)

月 日	時 間	講 義 科 目	講 師
11月7日 (水)	9:30~10:30	表面・界面概論	福田 安生 (静大電子研)
	10:40~12:00	FT-IR、ラマン分光	永井 直人 (東レリサーチセンター)
	13:00~14:20	電子顕微鏡	横田 康広 (岡山理科大)
	14:30~15:50	走査プローブ顕微鏡 (STM/AFM)	森田 清三 (阪大工)
	16:00~17:10	電子線マイクロアナライザ (EPMA)	林 広司 (島津)
	17:20~18:00	総合討論	福田、吉川、横田、森田、林
11月8日 (木)	9:30~10:30	電子分光装置の基礎	大岩 烈 (アルバック・ファイ)
	10:40~12:00	オージェ電子分光法 (AES)	笹川 薫 (コベルコ科研)
	13:00~14:00	X線光電子分光法 (XPS)	薄木 智亮 (住友金属テクノロジー)
	14:10~15:10	イオン散乱法 (ISS/MEIS/RBS)	片山 光浩 (阪大工)
	15:20~16:40	二次イオン質量分析法 (SIMS)	奥野 和彦 (東レリサーチセンター)
	16:50~17:30	総合討論	大岩、笹川、薄木、片山、奥野

